

как электронов, так и ионов. Решение системы (1), (2), (9) в условиях  $I_e(0) > 0$ ,  $I_i(0) < 0$  и  $|I_e(0)| \approx |I_i(0)|$  позволяет получить осевые распределения концентрации и потенциала с максимумом, хорошо согласующиеся с экспериментально наблюдаемыми в работе [5].

В заключение отметим, что в разряде с полым катодом особенности системы инициирования такого разряда могут в значительной степени влиять на распределение параметров плазмы в полости. Учет этих особенностей при анализе может быть реализован соответствующим выбором граничных условий, в частности, во входном отверстии катодной полости.

### Список литературы

- [1] Крейндель Ю.Е. Плазменные источники электронов. М.: Атомиздат, 1977.
- [2] Груздев В.А., Осипов И.В., Ремне Н.Г. // Всесоюз. симпозиум по сильноточной электронике. Томск, 1988. С. 95–97.
- [3] Груздев В.А. // Изв. вузов. Физика. 1970. № 5. С. 136–138.
- [4] Кириченко В.И., Ткаченко В.М., Тютюнник В.Б. // ЖТФ. 1976. Т. 46. Вып. 9. С. 1857–1867.
- [5] Москалев Б.И. // ЖТФ. 1988. Т. 58. Вып. 10. С. 2056–2059.
- [6] Решенов С.П. // ЖТФ. 1981. Т. 51. Вып. 7. С. 1393–1402.

Томский институт автоматизированных систем  
управления и радиоэлектроники

Поступило в Редакцию  
30 июля 1991 г.  
В окончательной редакции  
22 января 1992 г.

01  
© 1993 г.

Журнал технической физики, т. 63, в. 1, 1993

## РЕЛЯТИВИСТСКОЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПРОВОДНИКА С ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

B.B.Митянов, H.A.Поклонский

Исходя из нерелятивистских представлений установлено [1], что проводник с линейно растущим (или убывающим) во времени замкнутым током является источником электростатического поля. Конечно, время жизни такого источника поля принципиально ограничено.

В рамках специальной теории относительности покажем, что однородный проводник электричества, в котором электроны равномерно движутся относительно положительно заряженного фона, порождает электростатическое поле, существующее сколь угодно долго (пока существует ток).

Рассмотрим проводник в виде отрезка прямой нити (проводники) длиной  $L$  и площадью поперечного сечения  $S$ , в котором существует электрический ток

$$\mathbf{I} = -enS\mathbf{v}, \quad (1)$$

где  $-e < 0$  — заряд электрона,  $n$  — средняя объемная концентрация электронов проводимости,  $\mathbf{v}$  — дрейфовая (токовая) скорость.

В нити с током находится  $nSL$  электронов проводимости, движущихся со средней скоростью  $v$ , и столько же неподвижных положительных зарядов атомных остатков (остовов). Учтем, что в лабораторной системе координат электрические поля, создаваемые подвижными и локализованными зарядами нити, разнятся (следствие преобразований Лоренца). Так, напряженность электрического поля, равномерно движущегося со скоростью  $v$  электрона на расстоянии  $R$  от него, равна [2]

$$E_- = -\frac{eR}{4\pi\epsilon_r\epsilon_0 R^3} \frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}},$$

где  $\epsilon_r$  — изотропная относительная диэлектрическая проницаемость среды между электроном и точкой наблюдения поля,  $\epsilon_0$  — электрическая постоянная,  $\beta = v/c$ ,  $c$  — скорость света в вакууме,  $\theta$  — угол между  $v$  и  $R$ .

Напряженность поля от неподвижного положительного заряда  $e > 0$  атомного остова равна  $E_+ = eR/(4\pi\epsilon_r\epsilon_0 R^3)$ . Суммируя поля от атомных остовов ( $E_+$ ) и электронов проводимости ( $E_-$ ) по всей нити с током, получаем, что на расстоянии  $R$  от центра нити в перпендикулярном току направлении релятивистское электростатическое поле

$$E_\perp = \frac{enSL}{2\pi\epsilon_r\epsilon_0 R} \left[ (L^2 + 4R^2)^{-1/2} - (L^2 + 4R^2(1-\beta^2))^{-1/2} \right];$$

при  $L \rightarrow \infty$  поле  $E_\perp \rightarrow 0$ .

Полю  $E_\perp$  нити конечной длины с током соответствует потенциал

$$\varphi_\perp = \int_R^\infty E_\perp dR = -\frac{enS}{2\pi\epsilon_r\epsilon_0} \ln \left\{ \frac{L + (L^2 + 4R^2(1-\beta^2))^{1/2}}{(1-\beta^2)[L + (L^2 + 4R^2)^{1/2}]} \right\}, \quad (2)$$

где учтено, что в бесконечно удаленной от нити точке  $\varphi_\perp = 0$ .

При  $\beta = v/c \ll 1$  из (2) с учетом (1) получаем

$$\varphi_\perp = -\frac{I^2 \mu_0}{4\pi\epsilon_r enS} \left[ 1 + \frac{4R^2}{L^2} \right]^{-1/2}, \quad (3)$$

где  $\mu_0 = \epsilon_0^{-1} c^{-2}$  — магнитная постоянная.

Из (3) следует, что при прочих равных условиях индуцируемый постоянным во времени током релятивистский электростатический потенциал  $\varphi_\perp$  тем больше, чем меньшим числом электронов проводимости обеспечивается поддержание в нити заданного тока, т.е. чем больше дрейфовая скорость электронов (в сверхпроводниках — токовая скорость движения носителей заряда).

Оценим  $\varphi_\perp$  от погруженной в жидккий азот ( $\epsilon_r = 1.4$ ) нити квадратного сечения из кристаллического антимонида индия ( $L = 1$  см,  $S = 0.3$  мм<sup>2</sup>,  $n = 10^{15}$  см<sup>-3</sup>) с симметричными омическими контактами и постоянным во времени током  $I = 0.1$  А [3]. Согласно (3), на расстоянии  $R = 1$  мм от центра нити  $\varphi_\perp \approx -14$  мкВ. Вклад в  $\varphi_\perp$  от подводящих к нити ток металлических проводов ( $n \approx 5 \cdot 10^{22}$  см<sup>-3</sup>) пренебрежимо мал. Уменьшение влияния неоднородности распределения зарядов по нити при измерении  $\varphi_\perp \propto I^2$  проще реализовать на переменном токе. Возможная инжекция электронов в  $n$ -InSb из плоских  $n^+$ -контактов [4] ограничена длиной

Дебая–Хюккеля  $\approx 0.1$  мкм, так что для регистрации  $\varphi_{\perp} \approx -14$  мкВ разность концентраций инжектированных электронов должна быть меньше  $10^{10}$  см<sup>-3</sup>.

Расчет релятивистского электростатического поля плоской проводящей пленки (длиной  $L$ , шириной  $W$ , площадью поперечного сечения  $S$  и толщиной  $S/W$ ) с плотностью тока  $I/S$  проводится аналогично. Для  $\beta \ll 1$  электростатический потенциал на расстоянии  $R$  от центра пленки в перпендикулярном ее поверхности направлении равен

$$\varphi_{\perp} = -\frac{I^2 \mu_0 L}{8\pi \epsilon_r e n S W} \ln \left\{ \frac{(L^2 + W^2 + 4R^2)^{1/2} + W}{(L^2 + W^2 + 4R^2)^{1/2} - W} \right\}. \quad (4)$$

Оценим  $\varphi_{\perp}$  от тока в эпитаксиальной пленке  $n$ -Si с  $n^+$ -контактами. При комнатной температуре в пленке ( $L = W = 1$  мм,  $S/W = 1$  мкм,  $n = 10^{16}$  см<sup>-3</sup>) можно возбудить постоянный ток  $I = 30$  мА [4,5]. Тогда, согласно (4), на "точечном" электроде, отделенном от пленки слоем аморфного SiO<sub>2</sub> толщиной 30 нм ( $\epsilon_r = 3.9$ ), возникает релятивистский электростатический потенциал  $\varphi_{\perp} \approx -12$  мкВ.

Отметим, что релятивистское электростатическое поле кристаллического полупроводника  $n$ -типа проводимости с током совпадает с полем полупроводника  $p$ -типа, если концентрация и дрейфовая скорость движения электронов равны концентрации и дрейфовой скорости дырок (электронных вакансий).

Релятивистское электростатическое поле порождается и сверхпроводником с током. Так, погруженная в жидкий гелий ( $\epsilon_r = 1.05$ ) пленка ( $L = W = 1$  см,  $S/W = 0.1$  мкм,  $n \approx 10^{22}$  см<sup>-3</sup>) с плотностью тока  $I/S \approx 10^6$  А/см<sup>2</sup> [6,7] индуцирует, согласно (4), на расстоянии  $R = 1$  мм от ее центра электростатический потенциал  $\varphi_{\perp} \approx -5$  мкВ.

Итак, справедливость преобразований Лоренца может быть подтверждена не только оптическими [8], но и электрическими измерениями.

### Список литературы

- [1] Миллер М.А. // УФН. 1984. Т. 142. № 1. С. 147–158.
- [2] Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля. М.: Наука, 1988. 512 с.
- [3] Владимиров В.В., Волков А.Ф., Мейлихов Е.З. Плазма полупроводников. М.: Атомиздат, 1979. 256 с.
- [4] Ржевский К.С. Физические принципы действия полупроводниковых приборов. М., 1986. 256 с.
- [5] Зи С. Физика полупроводниковых приборов. М.: Мир, 1984. 912 с.
- [6] Жуков А.А., Мошалков В.В. // Сверхпроводимость: физ., хим., тех. 1991. Т. 4. № 5. С. 850–887.
- [7] Кембелл А., Иванс Дж. Критические токи в сверхпроводниках. М.: Мир, 1975. 332-с.
- [8] Hils D., Hall J.L. // Phys. Rev. Lett. 1990. Vol. 64. N 15. P. 1697–1700.

Белорусский университет  
Научно-исследовательский институт  
прикладных физических проблем  
им. А.Н. Севченко  
Минск

Поступило в Редакцию  
30 июля 1991 г.